

KNbO₃ 电光偏转器*

卢秀权 陈绍和

(中国科学院上海光机所 上海 201800)

沈德忠

(北京人工晶体所 北京 100018)

提要 分析了 KNbO₃ 晶体的电光性质, 利用电光张量系数 γ_{33} 加工成电光偏转器, 偏转梯度电场由四个柱面电极产生。实验结果表明, 在结构参数、通光口径及其它条件均等同的情况下, 该器件的基本品质因子约是 LiNbO₃ 电光偏转器的 2 倍。

关键词 LiNbO₃ 晶体, 电光张量系数, 四极电场, 基本品质因子

1 引言

KNbO₃ 晶体是重要的具有钙钛矿结构的铁电材料, 在室温下, 它属于正交晶系, 对称类型为 $mm2$, 晶格参数: $a = 0.5695 \text{ nm}$, $b = 0.3973 \text{ nm}$, $c = 0.5721 \text{ nm}$ 。晶体有较大的非线性光学系数和高的光学破坏阈值^[1], 可直接倍频半导体激光, 除了可以用角度相位匹配外, 还能在相当宽的光波段内实现非临界相位匹配(NCPM), 因此被广泛用于光的倍频、和频、光频转换以及光学参量振荡。

表 1 作为电光偏转器材料的几种常用晶体

Table 1 Summary of some possible materials for making linear deflectors

E-O materials	transparency range/ μm	E-O coefficients $\gamma/\text{pm/V}$	$\lambda = 1.06 \mu\text{m}$		dielectric constants ϵ
			refractive index n	damage threshold / $\text{mW} \cdot \text{cm}^{-2}$	
ADP	0.2~1.2	23 (γ_{41})	$n_o = 1.52$ $n_e = 1.47$	~ 500	$\epsilon_1 = \epsilon_2 = 56$ $\epsilon_3 = 15$
KDP	0.2~1.5	11 (γ_{63})	$n_o = 1.50$ $n_e = 1.46$	~ 500	$\epsilon_1 = \epsilon_2 = 44$ $\epsilon_3 = 15$
KD [*] P	0.2~1.5	24.1 (γ_{63})	$n_o = 1.50$ $n_3 = 1.46$	~ 1000	$\epsilon_1 = \epsilon_2 = 58$ $\epsilon_3 = 50$
LiN-bO ₃	0.4~5.0	30.8 (γ_{33})	$n_o = 2.28$ $n_3 = 2.16$	~ 100	$\epsilon_1 = \epsilon_2 = 78$ $\epsilon_3 = 32$
KTP	0.35~4.5	35 (γ_{33})	$n_1 = 1.76$ $n_2 = 1.77$ $n_3 = 1.86$	> 500	$\epsilon_1 = 11.9$ $\epsilon_2 = 11.3$ $\epsilon_3 = 17.5$
KN-bO ₃	0.4~5.0	64 (γ_{33}) 380(γ_{42})	$n_1 = 2.22$ $n_2 = 2.25$ $n_3 = 2.11$	> 500	

* 国家高技术 863 基金资助项目。

KNbO_3 晶体还有较大的电光系数, 以前也许是由于生长优质晶体困难, 至今还很少有人报道它在电光器件方面的应用。然而, Grey Mizell 等人证明了采用他们的方法生长、处理之后的晶体, 光学质量好, 对 $0.4 \sim 5.5 \mu\text{m}$ 光波段透明。目前, 广泛应用于数据处理、光通讯, 条纹相机的电光偏转器一般采用 ADP, KDP, $\text{KD}^* \text{P}$, LiNbO_3 等晶体。这些晶体电光系数普遍偏小(参看表 1^[1,2]), 光要偏转一定角度需要相对较高的电压。在用于惯性约束核聚变(ICF) 的高功率激光装置(如神光-2[#]) 的驱动器中的时空变换脉冲整形系统的核心部件仍是 LiNbO_3 电光偏转器, 由于 LiNbO_3 晶体的光学破坏阈值相当低, 因而成为限制激光功率的因素之一。也有人考虑在这样一个整形系统中改用 KTP 电光偏转器, 但 KTP 晶体的电光系数 γ_{33} 也不大。本文先分析了晶体的电光效应, 然后采用合理的偏转器电极结构, 导出其基本品质因子, 在文章的结束部分给出了实验结果, 并指出有可能利用晶体的最大电光系数 γ_{42} 加工成电光偏转器, 这些都说明 KNbO_3 作为电光偏转器材料, 有它的优势。

2 电光效应

KNbO_3 晶体的电光效应可由电光张量系数 $\gamma_{13}, \gamma_{23}, \gamma_{33}, \gamma_{42}, \gamma_{51}$ 来描述^[2], 在外电场 $E = (E_1, E_2, E_3)$ 的作用下, 折射率椭球变成

$$\left[\frac{1}{n_1^2} + \gamma_{13}E_3 \right] x_1^2 + \left[\frac{1}{n_2^2} + \gamma_{23}E_3 \right] x_2^2 + \left[\frac{1}{n_3^2} + \gamma_{33}E_3 \right] x_3^2 - 2\gamma_{42}E_2x_2x_3 - 2\gamma_{51}E_1x_1x_3 = 1 \quad (1)$$

其中, n_1, n_2, n_3 为晶体主折射率, 现在, 我们分别讨论晶体在三个主轴方向加电场时的电光性质, 然后以此为根据, 考虑采用合理的偏转器电极结构。

1) 在 x_3 方向加电场, (1) 式退化成

$$\left[\frac{1}{n_1^2} + \gamma_{13}E_3 \right] x_1^2 + \left[\frac{1}{n_2^2} + \gamma_{23}E_3 \right] x_2^2 + \left[\frac{1}{n_3^2} + \gamma_{33}E_3 \right] x_3^2 = 1 \quad (2)$$

此时, 晶体主轴不旋转, 如图 1(a), 通常有 $1/n_i^2 \gg \gamma_{ij}E_3$, 可求得加电场后新的主折射率

$$n_{x1} = n_1 - \frac{1}{2}n_1^3\gamma_{13}E_3 \quad n_{x2} = n_2 - \frac{1}{2}n_2^3\gamma_{23}E_3 \quad n_{x3} = n_3 - \frac{1}{2}n_3^3\gamma_{33}E_3 \quad (3)$$

电场导致折射率的变化为

$$\Delta n_{x1}^a = -\frac{1}{2}n_1^3\gamma_{13}E_3 \quad \Delta n_{x2}^a = -\frac{1}{2}n_2^3\gamma_{23}E_3 \quad \Delta n_{x3}^a = -\frac{1}{2}n_3^3\gamma_{33}E_3 \quad (4)$$

2) x_2 方向加电场, (1) 式退化为

$$\frac{1}{n_1^2}x_1^2 + \frac{1}{n_2^2}x_2^2 + \frac{1}{n_3^2}x_3^2 - 2\gamma_{42}E_2x_2x_3 = 1 \quad (5)$$

此时, 晶体主轴绕 x_1 轴转一个角度 θ , 如图 1(b) 所示, 求方程(5) 系数矩阵本征值和本征矢, 或直接使用坐标旋转变换, 可以得到 θ 的大小(在 $E_2 \approx 10^6 \text{ V/m}$, θ 的典型值约为百分之一个弧度, 常被忽略) 和主折射率的变化

$$\Delta n_{x2}^b = \frac{1}{2}n_2^3\alpha^b\gamma_{42}^2E_2^2 \quad \Delta n_{x3}^b = \frac{1}{2}n_3^3\alpha^b\gamma_{42}^2E_2^2 \quad \Delta n_{x1}^b = 0 \quad (6)$$

其中, $1/\alpha^b = 1/n_2^2 - 1/n_3^2$ 。

3) x_1 方向加电场, 此时, 晶体主轴绕 x_2 轴转过一个小角度, 如图 1(c)。电场引起的主折射率变

化为

$$\Delta n_{x1}^c = \frac{1}{2} n_1^3 \alpha^c \gamma_{31}^2 E_1^2 \quad \Delta n_{x3}^c = -\frac{1}{2} n_3^3 \alpha^c \gamma_{31}^2 E_1^2 \quad \Delta n_{x2}^c = 0 \quad (7)$$

其中, $1/\alpha^c = 1/n_3^2 - 1/n_1^2$ 。

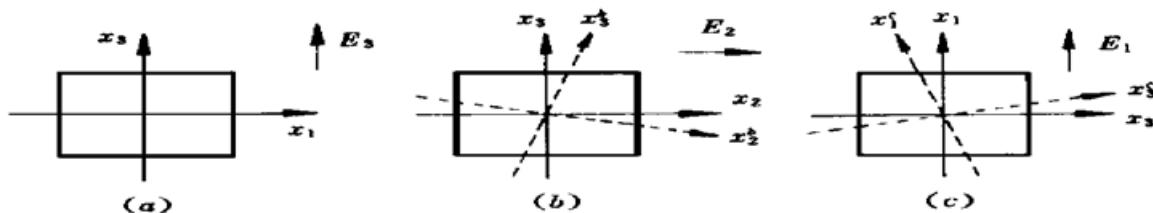


图 1 加上电场 $E_i (i = 1, 2, 3)$ 后, 晶体新的折射率主轴相对于原主轴的旋转

Fig. 1 The rotation of the new index principle axes with respect to the unperturbed principle axes when an electric-field E_i is applied, $i = 1, 2, 3$

3 偏转器结构及其基本品质因子

根据对 KNbO₃ 晶体电光效应的分析, 我们采用了图 2 示出的偏转器结构。相对晶体 x_1 轴和 x_3 轴 45° 方向切割, 光束沿 x_2 轴传播, 偏振方向为 x_3 方向。光偏转所需的梯度电场由四个圆柱电极提供^[3], 电极半径均为 r , D 为通光口径, 定义偏转器的结构参数 $S = r/D$ 。则光束通过长为 l 的晶体后, 在 x_1x_2 平面内转过的角度为

$$\Phi = -l \cdot \Delta n / D \quad (8)$$

其中, Δn 是光束在 x_1 方向两端所经历的最大折射率之差, 由(4) 式得

$$\Delta n = n_3^3 \gamma_{33} E_{3\max} \quad (9)$$

其中, $E_{3\max}$ 为晶体通光口径边缘 E_3 的极大值, 在确定了通光口径、结构参数之后, 它与外加电压成正比。

根据文献[4] 中的(2) 式, 电光偏转器的基本品质因子不是偏转角度 Φ , 而是偏转光束扫过可分辨光斑的个数 N

$$N = \Phi \cdot D / 2.44\lambda = (l / 2.44\lambda) n_3^3 \gamma_{33} E_{3\max} \quad (10)$$

由此可见, 偏转器基本品质因子与材料的电光系数 γ_{33} 成正比, 因而, KNbO₃ 电光偏转器的品质因子比相应 LiNbO₃ 晶体电光偏转器的品质因子大了许多。

当然, 在这种四极电场结构的偏转器中, 存在 E_1 电场沿 x_3 方向梯度分布的问题。但是进一步计算表明: 光束沿 x_3 方向的偏转可以忽略。

由(4) 式和(7) 式, 得到

$$R = \frac{\Delta n_{x3}^a}{\Delta n_{x3}^c} = \frac{\gamma_{33} E_3}{\alpha^c \gamma_{31}^2 E_1^2} \quad (11)$$

将 KNbO₃ 晶体的参数代入上式, 令 $E_3 = E_1 = 10^6$ V/m, $R \approx 51$ 。

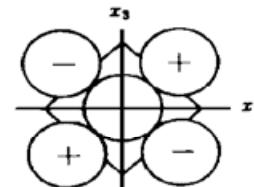


图 2 KNbO₃ 电光偏转的横截面

4 实验结果和讨论

实验使用的晶体尺寸为 $5 \times 5 \times 32$ (mm), 为了能在同等条件下与 LiNbO_3 电光偏转器^[7]作比较, 加工晶体时, 使用了同样的一些参数: 通光孔径 $D = 4$ mm, 结构参数 $S = 0.53$, 晶体长度 $l = 30$ mm(每个电极距晶体抛光端面各约 1 mm 左右), 用焦距为 740 mm 的透镜作偏转光束的傅里叶变换, 入射光波长 $\lambda = 1.06 \mu\text{m}$ 。经读数显微镜测得焦平面上光斑的移动量为 1.53 mm/kV, 偏转一个衍射极限的光斑所需电压为 313 V。据文献[5]报道, 利用 LiNbO_3 电光

偏转器, 得到焦平面上光斑的移动量为 0.79 mm/kV, 偏转一个衍射极限光斑所需电压为 605 V。

由此, 我们得到了用 KNbO_3 代替 LiNbO_3 的电光偏转器, 可将基本品质因子约增大一倍。

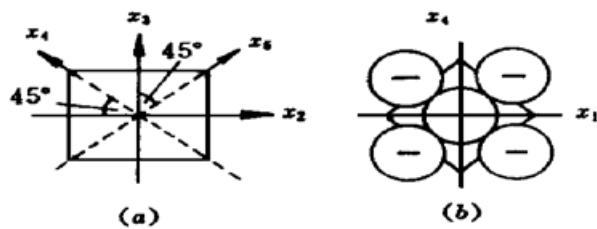


图 3 利用 Y_{42} 制成的 KNbO_3 电光偏转器

(a) x_4, x_5 的方向; (b) 电光偏转器的横截面

Fig. 3 Structure of the KNbO_3 deflector by using Y_{42}

(a) orientation of x_4, x_5 ; (b) cross section of the deflector

整个装置控制在室温工作(Y_{42} 随温度的升高而明显减小)。需要说明的是, 当光在双轴晶体中不沿主轴传播的时候, 光线矢量与光波矢量方向并不一致(本例中约有 $3^\circ \sim 4^\circ$ 的夹角)。

参 考 文 献

- 1 Liu Songhao, He Guangsheng. Optics of Intense Light and Its Applications. Guangzhou : Guangdong Science and Technology Publishing House, 1995, 27~ 28 (in Chinese)
- 2 J. D. Bierlein, C. B. Arweiler. Electro-optic and dielectric properties of KTiOPO_4 . *Appl. Phys. Lett.*, 1986, **49**(15) : 917~ 919
- 3 R. P. Kiyatkin. Analysis of control field in quadrupole optical-radiation deflectors. *Opt. Spectrosc.*, 1975, **38**(2) : 209~ 211
- 4 C. L. M. Ireland. A ~ 20 ps resolution crystal streak camera. *Opt. Comm.*, 1979, **30**(1) : 99~ 103
- 5 Xu Faming, Fan Dianyuan, Chen Shaohe et al.. Study of LiNbO_3 electro-optic detector. *Acta Optica Sinica* (光学学报), 1996, **16**(3) : 369~ 372 (in Chinese)

A KNbO_3 Electro-Optic Deflector

Lu Xiuquan Chen Shaohe

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800)

Shen Dezhong

(Research Institute of Synthetic Crystals, Beijing 100018)

Abstract In this paper, the electro-optical properties of a KNbO_3 single crystal was studied. A KNbO_3 deflector with four cylindrical electrodes, which utilizes the coefficient Y_{33} of the EO tensor, was made. Results of the experiment indicated that the fundamental figure of merit of the KNbO_3 deflector was about twice that of the LiNbO_3 crystal with equal structural parameters, aperture and length.

Key words KNbO_3 , coefficient of EO tensor, quadrupolar electric-field, fundamental figure of merit